Present Status of AVF Cyclotron at JAEA

Ikuo Ishibori^{A)}, Takayuki Nara^{A)}, Satoshi Kurashima^{A)}, Ken-ichi Yoshida^{A)}, Takahiro Yuyama^{A)}

Tomohisa Ishizaka ^{A)}, Susumu Okumura ^{A)}, Nobumasa Miyawaki ^{A)}, Hirotsugu Kashiwagi ^{A)}, Yosuke Yuri ^{A)},

Watalu Yokota^{A)}, Toshihiro Yoshida^{B)}, Katsuhiro Akaiwa^{B)}, Satoshi Ishiro^{B)}, Tsuyoshi Yoshida^{B)},

Satoshi Kano^{B)}, Akira Ihara^{B)}, Keisuke Takano^{B)}, Seigo Mochizuki^{B)}, Hiroyuki Saitoh^{B)}

A) Takasaki Advanced Radiation Research Institute. Japan Atomic Energy Agency

1233 Watanuki-machi, Takasaki-shi, Gunma, 370-1291, Japan

^{B)}Beam Operation Service, Co., Ltd.

1233 Watanuki-machi, Takasaki-shi, Gunma, 370-1207, Japan

Abstract

The AVF cyclotron (K=110 MeV) at JAEA (Japan Atomic Energy Agency) provides ion beams of a variety of species and energies with a number of irradiation methods mainly for research in materials science, biotechnology. The regular maintenance of the cyclotron is carried out every year selectively on different parts that appear to be deteriorated in order to reduce troubles and to stably provide the ion beams. This led to completion of all the scheduled beam time in fiscal 2006 and 2008. The following major developments are in progress; a magnetic field measurement system with an NMR magnetometer for a wide range of main magnetic field strength of the cyclotron, a multipolemagnet system for uniform-beam irradiation and a measurement system of beam acceptance of the cyclotron.

原子力機構 AVF サイクロトロンの現状

1. はじめに

日本原子力研究開発機構(JAEA)高崎量子応用研究 所のイオン照射研究施設 TIARA はAVFサイクロト ロン(K=110MeV)を有し、宇宙用半導体の耐放射 線評価や生物細胞への低線量照射の影響など、材 料・バイオ技術の研究を中心にイオンビームを提供 している[1]。ユーザーが要望する様々なイオン種・ エネルギーに対応するために、3台の外部イオン源 を用いてH⁺、D⁺などの軽イオンから¹⁹⁷Au³¹⁺まで多 くのイオン種を、10~90MeV(H⁺)、2.5~27MeV/u (重イオン)の様々なエネルギーに加速している。-般的なサイクロトロンは主に核物理研究や医療分野 に使用されているが、TIARAでは材料・バイオ技術 の研究に用いるために、カクテルビーム加速技術、 マイクロビーム照射技術、大面積均一照射技術など の高度な加速技術及び照射技術の開発を進めている。 これらの技術を安定に利用するため、サイクロトロ ン電磁石の磁場安定化や冷却水の温度安定化^[2]など 各種機器の安定化技術を開発した。また、装置の保 守管理を定期的・計画的に行うことで、上記の技術 に必要な基本性能を維持すると共に、安定なビーム 提供を実現している。

2. 利用運転及び定期保守・整備

TIARAサイクロトロンではJAEA内外の多様な ユーザーの要求に応えるために各種電磁石やイオン 源など多くの運転パラメータを高い頻度で変更して いる。2008年度においては642件の実験に利用され ており、イオン種及びエネルギー変更を234回、照 射コース切り替えを308回行い、運転時間は3162時

表 1	2008 年度のイオン種・エネルギー、	コー
	ス切り替え等回数	

234	日		
308	П		
57	П		
4.9	時間/件		
3.9	時間/件		
642	件		
	234 308 57 4.9 3.9 642		





間である(表1)。図1に2008年度の月毎の運転 状況の内訳を示す。年間の照射実験時間は2533.5時 間(全体の約80%)であるのに対し、イオン種・エネ ルギー変更やコース変更のための調整運転に約630 時間(全体の約20%)を費やしている。平均で1時間6 分の調整運転で各実験にビームを提供していること が分かる。また2007年度7月より文部科学省の『先 端研究施設共用イノベーション創出事業』を受託し て、民間企業を中心とした利用に年間約70時間を供 した。

TIARAではユーザーに安定なビームを提供するこ とが重要な使命であるため、定期的・計画的な保 守・整備により故障予防保全に重点を置くとともに、 故障への迅速な対応ができる態勢作りを進めている。 特に毎年7、8月に約6週間のサイクロトロン定期保 守・整備、11月に1週間の電磁石電源定期保守・整 備、3月に2週間その他の機器の保守・整備を実施し ている。保守・整備の内容は、高経年化が限られた 箇所に集中しないように、毎年計画的に替えている。 最近の代表的なものは、サイクロトロン本体に2台 設置されている共振器の4年振りの分解点検で、内 筒及び外筒のコンタクトフィンガーを全て交換した。 使用後のコンタクトフィンガーを観察すると外筒と の接点に発熱と思われる損傷の著しい部分がみられ た。ビーム調整に欠かせないマグネチックチャンネ ルプローブでは、ヘッド部のビーム計測用ブロック を長手方向が大きいものに交換することで、絶縁部 にビームが当たらない様にするとともに、水冷ブ ロックの形状を改良し、ビームを止めた際に発生す る熱に対する除熱能力を向上させ電流リード部への 輻射熱を低減させた。その結果、発熱による電流 リード部の劣化も改善された。デフレクターの電極 磨き及び電極交換などは毎年行っている。電磁石電 源に関しては、経年劣化が進んだ主要電磁石電源の コンデンサ類を交換、タイマーリレーは不良品が発 見され高経年化が疑われたため全数を交換した。サ イクロトロン本体系電源の内部機器による温度上昇 が著しい筐体には除熱用のファンを増設するなどの 整備を実施した。真空排気系では、サイクロトロン 本体に設置されている4台のクライオポンプの点検 整備を2年振りに実施した。

加速後のビームを正弦波で間引くS型ビーム チョッパーでは、アンプ筐体内に設置されている冷 却水ホースは全数を交換し、1992年の設置後初めて、 全ての電源回路に組み込まれている電磁接触器とリ レーの全数の交換を実施した。

定期保守・整備以外では、装置が故障した場合に 迅速な故障箇所の特定と修理を行った。例えば、近 年故障が多いサイクロトロンRFアンプの真空管交 換については、従来はメーカーに交換作業を依頼し たので2~3日を要していたが、現在は職員・オペ レーターの手により数時間で交換できるため、照射 実験に及ぼす影響は非常に小さい。この様な態勢を 積み重ねることにより2006年度に続き2008年度にも 計画外停止が無く年間運転利用率100%を達成した。

3. 主な技術開発の概要

3.1 磁場計測システムの開発

サイクロトロンの調整時間を短くして照射時間に 振替えることが強く求められている。従来の主電磁 石の起動シーケンス(サイクリング励磁)では、サ イクリング励磁による磁場立ち上げに約30分かかり、 調整時間を長くする要因となっている。このため加 速箱内に設置した核磁気共鳴(NMR)プローブで サイクロトロンの主磁場をリアルタイムで計測する ことにより短時間で磁場形成する技術の開発に着手 した。サイクロトロンの主磁場は既にNMRプロー ブで測定可能となっているが、その磁場強度は1.6-2Tに限定されており、全運転条件(0.6-2T)での測定 はできなかった。このため、全磁場強度範囲での計 測を可能とするNMRプローブを新たに開発した。 図2にNMRプローブの配置を示す。NMRプローブ は磁場の均一度が良好でないとノイズが大きく測定 できない。そのためサイクロトロン磁極間のアース 板上で2次元的にプローブを動かすマニピュレータ を製作し均一な場所を探査した。その結果、0.6~ 2Tの全域をNMRプローブで測定できるようになっ た^[3]。



図2:サイクロトロン内部に設置したプローブ。左 が従来型、右が全磁場強度範囲対応型。

3.2 多重極電磁石を用いた均一ビーム照射技術の開発

従来からTIARAサイクロトロンではラスタース キャン方式による最大10cm×10cmの大面積均一照射 が利用されている。この方式は、2方向に異なる周 波数(水平方向:50Hz、鉛直方向:0.25~5Hz)で双 極磁場を変化させスポットビームを掃引する。つま り、局所的には、フルエンス率は一定ではなく、ス キャン周波数に依存してゼロから非常に高い値まで 周期的に変化する。スポットビームによる照射試料 の加熱や局所的なフルエンス率の周期的変化が許容 できない実験にはスキャンによる照射では対応でき ない。また、良い均一度を得るには、スキャンの周 期に比べて照射時間を十分長くしなければならない など、高い均一性を保ちつつ低フルエンスを実現す ることは難しい。そこで、このような既存方式の欠 点を補う新たな均一照射法として、非線形集束力に よってビーム均一化ができることに着目し、拡大照 射野のビーム照射技術を開発している^[4]。8極電磁 石等のつくる非線形集束力によりビームの横方向強 度分布のテイルを内側へ折り畳み均一化する。ビー ム自身が均一な強度分布を有するので、広い照射野 全体を同時に一定のフルエンス率で照射することが 可能である。



図3:多重極電磁石のビームライン構成

ビームラインには、ビームの広がりのテイルを折り 畳むための8極電磁石に加え、ビーム重心が中心軌 道からずれた場合に補正する6極電磁石が設置され ている。図3に各電磁石の配置を示す。拡大形成さ れたビームの均一度は元のビーム分布にも大きく依 存する。十分に均一なビームを形成するには、初期 分布はガウス分布や放物線分布のように滑らかであ る必要がある。サイクロトロンのビームはこの様な 分布と大きく異なるため、ビームラインの2ヶ所に 散乱体(薄膜)を導入してガウス分布化を図ってい る。その結果、10MeV-H⁺ビームを用いてこれまで に6cm×6cmの均一照射野を形成し6%の均一度を達 成した。フルエンス率やフルエンスを広範囲にわ たって変更するには、サイクロトロン入射系に設置 されている銅製多孔シートを用いたビームアテネー タを使用する^[5]。パルス電場によるビームチョッピ ングを用いて1us以下の短時間照射も可能である。

現在は均一度の評価にフィルム線量計を使用して いるが、ビーム誘起蛍光を用いた計測系の開発を進 めている。

3.3 アクセプタンスモニターの開発

サイクロトロンへのビーム入射及び加速における ビームロスを低減するためには、サイクロトロンの アクセプタンスに入射ビームのエミッタンスを整合 させる必要がある。サイクロトロンのアクセプタン スは設計時に大まかに検討されたことがあるが、実 ビームを用いて測定されたことはない。このため、 この整合を評価するためのエミッタンス及びアクセ プタンスを測定する装置をビーム入射ラインに据え 付けた。図4に装置の全体写真を示す(ビームは写 真左側から入射される)。本装置を用いて今後サイ クロトロンのアクセプタンスと入射されるイオン ビームのエミッタンスのマッチングを明らかにする。



図4:アクセプタンスモニターの構成。①位置制 限スリット(y)、②、④角度分布測定器、③角度 制限スリット(y)、⑤角度制限スリット。

参考文献

- K. Arakawa, et al., Proceedings of the 13th International Conference on Cyclotrons and their Applications, Vancouver, Canada, (1992) 119,
- [2] S. Okumura, et al, "Magnetic field stabilization by temperature control of an azimuthally varying field cyclotron magnet", Rev. Sci. Instrum. 76 (2005) 033301.
- [3] S. Okumura, et al, "Development of a magnetic field monitoring system for the JAERI AVF cyclotron", Nukleonika 48, Suppl. 2 (2003) S35.
- [4] Y. Yuri et al., Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 33rd Linear Accelerator Meeting Japan, August 6-8, 2008., Higashihiroshima, (2008) 397.
- [5] T. Yuyama et al., Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 33rd Linear Accelerator Meeting Japan, August 6-8, 2008., Higashihiroshima, (2008) 259.